## 講座:ミリ波・サブミリ波計測の基礎と応用な

# 6. プラズマのミリ波・サブミリ波帯先端計測技術

間 瀬 淳 (筑波大学プラズマ研究センター) (1995年 5 月10日受理)

Advanced Millimeter- and Submillimeter-Wave Plasma Diagnostic Technology

MASE Atsushi

Plasma Research Center, University of Tsukuba, Tsukuba 305, Japan

(Received 10 May 1995)

#### Abstract

Recent development of millimeter- and submillimeter-wave technology for plasma diagnostics are briefly reported. Two new areas of diagnostics, 2–D interferometry/radiometry and advanced pulse radar reflectometry, are identified where the invaluable contributions will be made in order to understand magnetically confined fusion plasmas.

#### Keywords:

plasma diagnostics, millimeter- and submillimeter-wave, advanced technology,

#### 6.1 はじめに

前章までに記述されていたように、ミリ波・サ ブミリ波帯電磁波は、長波長マイクロ波に比較し 鋭い指向性が得られること、可視光や赤外線に比 べ霧や降雨時の減衰が少ないという伝播特性か ら、プラズマ計測のみならず地球環境観測あるい は宇宙観測の分野など幅広く利用されている.地 球環境観測あるいは宇宙観測の受信システムは、 遠方からの微弱電波を測定する必要上、非常に高 い指向性をもつアンテナと積分時間を十分とった 超高感度受信器で構成されている.一方、プラズ マ計測においては特に時間・空間分解が重視され ているなどの特徴がある.

ミリ波・サブミリ波プラズマ計測の進展は, i)

プローブビーム(光源)の開発はもちろんのこと, ii)集積化技術,超精密加工技術の進歩,および iii)超高速デバイスの開発に帰するところが大き いが,iv)データ収集および解析技術,すなわち ハードおよびソフトの両面にわたる計算機システ ムの発達なども大きな要因となってきた.良く知 られているように,近年の短パルス技術,光干渉 技術,画像処理技術の進展は著しい.ミリ波・サ ブミリ波プラズマ診断の分野でもこれらの技術 的発展に基づいた,最近の高空間分解測定および 超高速測定について記述する. 講 座

## 6.2 プラズマ計測用光源および検出器の 現状

現在研究が盛んに進められている反射計測法, 電子サイクロトロン放射(Electron Cyclotron Emission: ECE)計測法,特に ECE イメージン グ,さらには熱揺動からのコレクティブ散乱計測 法の各計測法を大型装置でルーチン的に適用して いくためのハードウェアの開発は未だ十分とはい えない.また,干渉・偏光,放射および波動散乱 など既存の計測法に対しても入射光源や検出器の 改良は不可欠である.本節では,プラズマ計測の 分野で使用されているミリ波・サブミリ波光源お よび検出器の現状について記述する.

光源について比較した結果を Table 1 に示す. 透過干渉計には主としてサブミリ波帯を使用する ため光励起あるいは放電励起形 CW 遠赤外レー ザーが適用されている. 散乱測定に正常波モード を使用する場合は干渉計と同じ波長領域である が,微小信号となるため SN 比の改善を目的とし て出力の大きい光源を用いる. 例えば,電子管と しては後進波管 (Backward Wave Oscillator: BWO) およびジャイロトロン,レーザーとして は光励起型大出力遠赤外レーザーなどである. 一 方,反射計およびサイクロトロン放射測定のため のヘテロダイン受信機は主としてミリ波帯に位置 しているため,ガン発振器などの固体発振器が使 用されている. 幅広い周波数同調範囲が必要なと きには, BWO や 固 体 発 振 器 で あ る HTO (Hyperabrupt Varactor-Tuned Oscillator)を 値したものが使用可能である.特に後者は高速掃 引特性を有している.また,散乱測定に異常波モ ードを使用する場合は大出力ミリ波ジャイロトロ ンが適用されている.

電磁波の検出器は、その動作原理から、熱検出 を行うもの、光子吸収によるもの、ダイオードの 整流作用によるものに分類される。特にミリ波-サブミリ波帯においてはそれぞれ、InSb ボロメー タあるいは焦電形検出器、Ge: Ga 光伝導検出器、 ショットキー・バリア・ダイオード (Schottky Barrier Diode: SBD) が代表的なものである。そ の動作領域、性能および特徴を Table 2 に比較し た.

Туре	Wavelength	Power	Tuning bandwidth	Comments
Optically pumped laser	119 µm 385 µm	0.45 W 400 kW, 1.5µs	~5 MHz	Multichannel interferometry Collective scattering from ion thermal fluctuations
Discharge gas laser	190 µm	1.3 W	~5 MHz	Multichannel interferometry
Gunn oscillator	2-3 mm	0.01-0.1 W	1 GHz(E.T.) 6 GHz(M.T.)	Narrowband reflectometry, ECE
IMPATT oscillator	4 mm 3 mm	0.5 W 0.2 W	500 MHz(E.T.) 5 GHz(M.T.)	Narrowband reflectometry
HTO+Multiplier	3-5 mm	0.01 W	60-90 GHz.	Fast sweep broadband reflectometry
Backward wave oscillator (BWO)	4-6 mm 0.8 mm	0.01-0.1 W 1 W	50-75 GHz	Broadband reflectometry Collective scattering from waves
Gyrotron	0.7-4 mm 2, 5 mm	110 W, 0.6 ms 200-400 kW	75-400 GHz	Collective scattering from waves Collective scattering from ion thermal fluctuations

Table 1. Milimeter- and Submillimeter-Wave Sources

E.T.: Electronic tuning

M.T.: Mechanical tuning

#### プラズマ・核融合学会誌 第71巻第6号 1995年6月

Туре	Wavelength [mm]	Respose	Video NEP [W/Hz <sup>1/2</sup> ]	Comments
InSb	0.1-3	1-5 µs	~10 <sup>-13</sup>	Need liquid helium cooling
Pyroelectric detector	<1	1 μs 10 ms	~10 <sup>-7</sup> ~10 <sup>-9</sup>	Room temperature operation
Ge:Ga	0.01-0.1	1 µs	~10 <sup>-13</sup>	Need liquid helium cooling
Schottky barrier diode	> 0.1	< 1 ns	~10-10	Room temperature operation, Respose depend on IF amplifier

Table 2. Milimeter- and Submillimeter-Wave Detectors

## 6.3 二,三次元高空間分解測定

6.3.1 プラズマのイメージング

多数個の検出器を配列したプラズマ計測法は, プラズマパラメータの空間分布およびその揺動成 分のパワースペクトル密度と分布測定に極めて有 効である.電磁波を用いた計測法を多次元化する ことにより,密度の二次元分布,また,揺動成分 の二次元波数スペクトルの導出が可能となり,揺 動に起因する輸送現象の解明に寄与する.ミリ 波・サブミリ波帯では,プレーナー型多チャンネ ル検出器を用いた位相イメージング,ECE イメー ジングへの適用が研究されている.検出器にはア レイアンテナにダイオードを接着するハイブリッ ド型検出器,両者が一体化したモノリシック型検 出器がある.

ハイブリッド型検出器アレイは、ボウタイアンテ ナあるいは八木宇田アンテナで構成されたアンテ ナアレイに検出器が接着されたもので、検出器と してはマイクロボロメータあるいはショットキー バリアダイオードが用いられている. ヘテロダイ ン検波の場合広帯域の中間周波数 (Intermediate Frequency: IF)をもつ後者を用いることが多い. Fig. 1(a)がハイブリッド型二次元検出器アレイ の例で、大きさ38.1 mm×38.1 mm、厚さ1 mm の石英基板上にフォトリソグラフィーにより4× 4 配列のボウタイアンテナを蒸着し、各アンテナ の給電点にビームリード形 GaAs ショットキー バリアダイオードが装着されている. なお、検出 器基板には基本波導波管で構成された二次元アン テナアレイを取り付けている.本検出器は Fig. 1 (b) に示される周波数70GHz 帯のヘテロダイン 型位相イメージ法干渉計および ECE 測定に適用 された[1].

カットオフ周波数~400GHz をもつビームリー ド形 GaAs ショットキーバリアダイオード[2]を 用いたハイブリッド型アレイ検出器は、94GHz においても良好なヘテロダイン検波特性 (SSB 変 換損失:18dB, DSB 雑音温度:9,700K)を有す ることが確認されている[3].現状において周波 数100-200 GHz 領域で動作することが期待され, ECE イメージングによる電子温度分布およびそ の揺動成分の測定、特に、米国テキサス大学の TEXT-U トカマクあるいは核融合科学研究所 CHS ヘリカル装置などトーラスプラズマにおけ る MHD 不安定性研究への適用が検討されてい る. ECE イメージング装置の概略を Fig. 2 に示 す. 相関法との併用で等磁束面上で多点測定を行 うことにより、熱パルス輸送実験に適用できるな どの特徴も有している[4].

ITER などの大型装置における ECE 測定は, 周波数400-500 GHz まで拡張されることが予想さ れ,アンテナと検出器素子が一体となったモノリ シック型検出器アレイが研究されている.その例 を Fig. 3 に示す[5].このモノリシックアレイは GaAs ウエハ上に分子線エピタキシャル成長法 (MBE)により製作され,ダイオード直列抵抗



Fig. 1(a) Layout of hybrid two-dimensional detector array, (b) Schematic diagram of the GAMMA 10 phase imaging interferometer system [1].



Fig. 2 Schematic of ECE imaging system.

9-12Ωが得られており、カットオフ周波数は 660-890 GHz と予想されている.

#### 6.3.2 ファンビームを用いた干渉測定

核融合プラズマ実験装置においては、測定ポー トの制約から、密度分布などの測定に反射計の適 用が有力とされている.反射計は周辺部の測定に は空間精度が高いことなど利点が多いが、中心領 域の測定は不得意とされている.これに対し、干 渉計はアーベル変換時の周辺部の分布誤差が大き いなどの短所がある.したがって、両者を相補的 に用いてプラズマ全体の分布を決定することが不 可欠となる.一方,通常の多チャンネルサブミリ



Fig. 3 Layout of monolithic detector array [5].

波干渉計の光路を同一断面上に設置することは測 定ポートの大きさの関係から困難となっている. ITER のために考えられているのが放射状の入射 ビーム,いわゆるファンビームを用いたマイケル ソン干渉計である.そのような入射ビームを作り 出すために種々の方法が考えられている.第一に, 溝の周期を変化させた回転格子を用いたビームの 分離がある[6].回折格子への入射角と反射角の 間にはよく知られた次式の関係がある.

$$\sin \alpha + \sin \beta = m\lambda/d \tag{1}$$

したがって、回転格子への入射角  $\alpha$ , 波長  $\lambda$  を

一定とすると, 溝の幅 *d* を変化させることによ り反射角 β が変化し, ファンビームが得られる ことになる.このとき周波数シフトも同時に作り 出されるため,各光路間のクロストークが抑えら れる.

一方,機械的な回転格子の代わりにショットキ ー・バリア・ダイオードなどの素子を用いたアレ イ形ビームコントローラにより入射ビームに周波 数シフトとビーム偏向を持たせることが考えられ ている[4].このときファンビームは小型送信ホー ンを経由して作り出される.

#### 6.4 高時間分解測定

#### 6.4.1 短パルスミリ波の飛行時間測定

良く知られているように、反射計を用いた密度 分布測定の最大の課題は、周辺プラズマ部密度揺 動によるフリンジ変化の影響を如何に除去するか である.そのため種々の方法が考えられてき た[7].その一方法である短パルスミリ波を用い たレーダ法では、パルス幅~200psの入射光源に より空間分解~10cmが実現されている[8]. ITER等の大型装置では、密度および温度などの 基礎パラメータの測定は空間分解~30cmが予定 されており、500psのパルス幅で良いことになる. 現在周波数110 GHz までは市販のピンダイオード 変調器により上記ミリ波パルスを得ることができ るが、それ以上の周波数帯は開発段階である.信

> Initial pulse shape vs. x 1.0 0.05 (a) pulse Electric Field wpe<sup>2</sup> plasma 0 0 ß 000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Position x

号処理は検波の後サンプリング時間~50psの A/D 変換器を使用することにより行われる.本 方法では密度分布を決定する際,周波数の関数と しての位相量をアーベル変換する必要がないとい う利点があるが,広帯域掃引発振器あるいは何台 かの周波数固定発振器が必要であることには変わ りがない.

#### 6.4.2 超短パルス波・プラズマ相互作用

時間幅  $\tau_p$ をもつ短パルスはそのフーリエ成分 として最大  $\omega_{max} = 2\pi/\tau_p$ の周波数広がりをもっ ているため、周波数がミリ波領域に達するパルス 幅50ps 以下の超短パルス波は、一台のパルス発 振器で多数個の周波数固定発振器あるいは広帯域 掃引発振器と等価な役目をもつことになる.この パルスが空間的に非一様なプラズマ中を伝播する とき、種々のフーリエ周波数成分はカットオフ層 の位置の違いにより反射波に時間差が生じるた め、検出器到達時間と周波数スペクトルを測定す ることにより、プラズマの密度分布を決定するこ とができる.

ー次元近似を用いた超短パルス反射計の計算機 シミュレーションの例を Fig. 4 に示す[9]. Fig. 4(a) に描かれているように,初期条件として電 界が

$$E(x, t=0) = \exp[-(x-x_{\rm p})^2/\tau_{\rm p}^2]$$
 (2)

で記述されるパルスが、



Fig. 4 (a) Initial configurations of electromagnetic pulse and plasma density as a function of position,

(b) Reflected electromagnetic pulse vs. x [9].

$$n_{\rm e}(x) = \begin{cases} n_0 \exp[(x-x_0)/L_{\rm s}], & x < x_0 \\ n_0[1+(x-x_0)/L_{\rm s}], & x \ge x_0 \end{cases} (3)$$

のような密度分布をもつプラズマに入射されると きを考える.ここで, $x_p$ はt = 0における入射パ ルスの規格化位置, $L_s$ は密度の特性長で,図で は規格化座標で $L_s = 120$ に選んでいる.既に述 べたように(2)式で表される短パルスは特性周波 数  $\omega_0 = \pi/2\tau_p$ をもち,最大周波数  $\omega_{max} = 2\pi/\tau_p$ で分布するスペクトルを有する.最初に反射する 最小周波数成分に比較して最大周波数成分は ( $\omega_{max}/\omega_0$ )<sup>2</sup> $L_s$ で表される距離を伝播する.した がって反射波パルスは  $2(\omega_{max}/\omega_0)^2 L_s$ の広がり を持つことが推定される.これは規格化座標で~ 3800に相当し,Fig.4(b)のシミュレーション結 果とよく一致している.

フーリエ変換スペクトルの高周波成分のうちカ ットオフ周波数より大きい成分はプラズマ中を屈 折あるいは電子サイクロトロン共鳴周波数領域で は吸収を受けながら透過する.この電磁波の屈折 はプラズマの密度の関数,また,吸収は密度およ び電子温度両者の関数であるため,透過波の周波 数スペクトルを測定することにより電子温度を決 定することも可能となる.

実験では,数 ps~数10ps の時間幅を持つイン パルスを入射,反射波および透過波のフーリエス ペクトルの時間変化を測定することになる.工学 的課題としては,i)超短パルスの発生,ii)広 帯域伝送回路および放射アンテナの設計製作,さ らにii)超高速波形計測技術の開発がある.

#### 6.4.3 超高速計測技術の開発

現在市販されているインパルス発生器はパルス 幅65ps,出力電圧10 V を発生する.研究開発段 階であるが,超短パルスの発生に非線形伝送線路 (Nonlinear Transmission Line: NLTL)を利用す る方法が研究されている.NLTL は,原理的に は高周波バラクタを周期的に配列したもので,並 列容量が電圧に依存するため,伝送線路のインダ クタンスを L とすると,回路中の入力パルスの 伝播速度が  $v_p = 1/\sqrt{LC(V)}$ のように振幅に依存 するようになる.これにより出力パルスの立ち上 がりを制御することが可能となる.さらに回路の フィルター特性もあるため短パルスが生成される ことになる.実際,ボウタイアンテナあるいはス ロットアンテナにビームリード形 GaAs ハイパー アブラプト・バラクタダイオードを接着したハイ



Fig. 5 Schematic diagram of the CCT ultrashort-pulse refectometer system [10].

ブリッド型線路により  $\tau_p \sim 65 \text{ ps}$ ,出力 5 V が得 られており,米国 UCLA の CCT 装置において 超短パルス反射計の原理的実証実験が試みられて いる.装置の概略を Fig.5 に示す[10].一方, 数 ps のパルスの発生にはモノリシック型 NLTL が有望であり,GaAs あるいは InP をベースとし た量子障壁バラクタにより,パルス幅~2ps,出 力電圧150 V が期待されている.

広帯域伝送線路としては,矩形オーバーサイズ 導波管あるいは円形コルゲート導波管が通常用い られている.後者では,低損失のHE<sub>11</sub>モードが 伝播し,内径6.35cm (2.5インチ)の導波管によ り50-250 GHz の帯域にわたって0.01 dB/m 以下 の減衰特性が測定されている.また,伝播方向の 変更にはマイターベンド (<0.1 dB/ベンド)を 使用する[11].

超高速波形計測の研究も進められている.もち ろん波形ディジタイザにより A/D 変換し, 信号 処理することは可能であり、そのときには波形解 析が忠実に行われる利点もある.現実に最高サン プルレート 5-100 ps をもつトランジェントディ ジタイザも市販されている. ただし, これにより プラズマ維持時間にわたってデータ収集するため には膨大な記憶容量が必要となる.一方、時間間 隔カウンタあるいは時間 - 電圧変換後データ収集 する方法があり、低速の A/D 変換器を用いるこ とができる.この方法で現在50-70 psの時間分 解が得られている. さらに高時間分解を得るため 考えられているのが量子化機能素子を用いた方法 である. 共鳴トンネル効果を利用した共鳴トンネ ルダイオード (Resonant Tunneling Diode: RTD)の高速スイッチング特性を利用したもの で、これをサンプリングヘッドに用いた InP 基 板上のモノリシック集積回路により時間-電圧変 換を行うことで10 ps 以下の時間分解が可能とさ れている[12].

## 6.5 ニューラルネットワークとプラズマ パラメータ

プラズマ計測の信号処理にニューラルネットワ ークを応用する試みが始まっている.例えばプラ

ズマの分布を決定する際計算機処理が必要となる が、関数近似のため従来用いられてきた反復法 (Iteration Method) に比較し、ニューラルネッ トワーク・アルゴリズムは計算時間の大幅な短縮 をもたらすことが期待され、また、初期条件の仮 定も不要という特長がある. これまでに ECE 測 定あるいは反射計測定におけるカーブフィッティ ングや像再生への応用例がある[13-15]. 一例と して,反射計により密度分布を導出する過程を考 えると,周波数掃引形反射計では周波数の関数と しての位相変化  $\phi(f)$  が得られるが,最初にエッ ジの点を仮定し、逐次計算により分布を決定して いくため相当な計算時間が必要となることが多 い.ニューラルネットワークでは当初シミュレー ションにより多くの関数例を入力しておくことに より, 測定点から直接適当な分布を実時間で決定 することができる.

### 6.6 まとめ

ミリ波・サブミリ波プラズマ計測は、磁場核融 合装置において必要不可欠なものとなっており、 各コンポーネントの開発もさらに進められていく ことが期待される.次期大型装置を対象とした時、 各計測法で必要と考えられている波長あるいは周 波数領域は以下のようになる.

1) 干渉計:波長5-200µm の使用が考えられ る.サブミリ波を使用するときには、多チャンネ ルおよび安定動作のために、小型かつプレーナー 型のショットキー・バリア・ダイオード検出器の 開発が望まれる.

2) 反射計:周波数26-90 GHz, 100-400 GHz が主要領域である.この領域をできるだけ少ない ハードウェアでカバーするためには,広帯域の掃 引発振器および逓倍器,ショットキー・バリア・ ダイオード検出器の開発が必要である.また,超 短パルスレーダのためには時間応答10 ps 以下の 超高速信号変換器,パルス幅1-10 ps,出力~ 100 V のインパルス発振器の開発が必要である.

3) サイクロトロン放射計:100-800 GHz が測 定領域となる.広帯域分散型ミキサーあるいはア レイ型検出器/ミキサーの開発が待たれる. 4) コレクティブ散乱:正常波モードでは干渉 計と同様で波長領域 5-200μm となるが,熱揺動 散乱の場合には,レーザーの完成度から波長~ 10μm の CO<sub>2</sub> レーザー散乱が有望とされており, 原理的実証のための実験が望まれている.異常波 モードでは60-140 GHz が主要範囲である.

## 参考文献

- [1] N. Oyama, A. Mase, T. Tokuzawa, Y. Ito, A. Itakura and T. Tamano, Jpn. J. Appl. Phys. 36, 2006 (1995).
- [2] 三洋電機株式会社, SBL-221.
- [3] G. Cima, US-Japan Workshop on Development of Millimeter- and Submillimeter-Wave Technology for Diagnostic Applications for Large Plasma Devices, Los Angeles, 1992.
- [4] N.C. Luhmann, Jr., US-Japan Workshop on Development of Millimeter- and Submillimeter-Wave Technology for Diagnostic Applications for Large Plasma Devices, Tsukuba (1994) p. 1-1.
- [5] R.P. Hsia, W.R. Grek, S. Cheng, W-M. Zhang, C.W. Domier and N.C. Luhmann, Jr., Rev. Sci. Instrum. 66, 834 (1995).
- [6] J. Howard, Rev. Sci. Instrum. 61, 1086 (1990).
- [7] M. Nagatsu, J. Plasma and Fusion Res. 71, 132 (1995); C. Manso, Progress Meeting on Micro-

wave Systems for ITER, San Diego, Jan. 1995.

- [8] S.H. Heijnen, M. deBaar, A.J.H. Donné, M.J. van de Pol, C.A.J. Hugenholtz and the RTP team, Rev. Sci. Instrum. 66, 419 (1995).
- [9] B.I. Cohen, B.B. Afeyan, A.E. Chou and N.C. Luhmann, Jr., Rev. Sci. Instrum. 66, 1241 (1995).
- [10] C.W. Domier, N.C. Luhmann, Jr., A.E. Chou, W-M. Zhang and A.J. Romanowsky, Rev. Sci. Instrum. 66, 399 (1995); 10th Topical Conference on High Temperature Plasma Diagnostics, Rochester, 1994.
- [11] E.J. Doyle, Progress Meeting on Microwave Systems for ITER, San Diego, Jan. 1995.
- [12] A. Miura, US-Japan Workshop on Development of Millimeter- and Submillimeter-Wave Technology for Diagnostic Applications for Large Plasma Devices, Tsukuba (1994)
  p. 13-1.
- [13] C.M. Bishop and C.M. Roach, Rev. Sci. Instrum. 63, 4450 (1992).
- [14] J. Sanchez, B. Branas, E. de la Luna, T. Estrada, V. Zhuravlev, H.J. Hartfuss, M. Hirsch, T. Geist, J. Segovia and J.L. Oramas, Plasma Phys. Reports 20, 1 (1994).
- [15] 岩間尚文,寺西大:「JT-60U プラズマ診断 用 ECE像再生に関する調査(Ⅲ)」日本原子力 研究所委託調査報告書,1995年2月.